

05;06;07;11;12

**ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ КИСЛОРОДА  
НА СПЕКТРЫ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  
И МАГНИТНОГО КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА  
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК  
ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА**

© А.И.Стогний,<sup>1</sup> О.Очилов,<sup>2</sup> К.М.Мукимов,<sup>2</sup>  
В.В.Федотова,<sup>1</sup> М.Г.Халмуратов,<sup>2</sup> А.Х.Рамазанов<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт физики твердого тела и полупроводников АНБ  
220726 Минск, Белоруссия

<sup>2</sup> Научно-исследовательский институт прикладной физики ТашГУ,  
700095 Ташкент, Узбекистан

(Поступило в Редакцию 15 мая 1995 г.

В окончательной редакции 13 ноября 1995 г.)

Исследованы изменения в спектрах оптического поглощения и магнитного кругового дихроизма эпитаксиальных пленок железо-иттриевого граната в видимой области длин волн, вызванные облучением ионами кислорода в диапазоне энергии от 0.5 до 10 кэВ и доз облучения от  $10^{18}$  до  $10^{20} \text{ см}^{-2}$ . Показано, что в оптимальных режимах облучения ионами кислорода с энергией от 1 до 2 кэВ и дозами  $2 \cdot 10^{19} \dots 4 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$  наблюдается смещение спектральных зависимостей к значениям, характерным для монокристаллов, что обусловлено доминированием процессов распыления поверхности и совершенствования кристаллической структуры пленок по толщине над процессом формирования нарушенного облучением слоя.

### Введение

Поиск и разработка методов улучшения свойств эпитаксиальных пленок феррит-гранатов, в том числе железо-иттриевого граната  $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ , занимает существенное место в развитии современной магнитооптики<sup>[1,2]</sup>. Это может осуществляться путем уменьшения в пленках таких источников дополнительного оптического поглощения (ОП), как примеси свинца технологического происхождения, несовершенства кристаллической структуры образцов и наличие катионов железа с валентностью, не равной трем. В работах<sup>[3,4]</sup> было показано, что при облучении поверхности пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ) ионами кислорода с энергией  $E \sim 1 \text{ кэВ}$  и с дозами  $D > 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$  наблюдаются повышение однородности исходных пленок за счет распыления неоднородного поверхностного слоя, уменьшение концентрации

нетрехвалентных катионов железа вблизи поверхности и совершенствования кристаллической структуры по объему. В данной работе были исследованы изменения ОП и магнитного кругового дихроизма (МКД) в пленках ЖИГ при воздействии облучения ионами кислорода в диапазоне энергий  $E = 0.5 \dots 10$  кэВ и с дозами  $D = 10^{18} \dots 10^{20}$  см $^{-2}$ . Особое внимание уделено участку спектра 500 ... 700 нм, внутри которого находится максимум ( $\lambda \sim 555.5$  нм), обусловленный присутствием свинца [1,5].

## Методы исследований

В качестве объектов исследования использованы монокристаллические пленки ЖИГ толщиной от 6 до 12 мкм, выращенные методом жидкофазной эпитаксии и раствор-расплава PbO/B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> на подложках галлий-гадолиниевых гранатов ориентацией (111).

Процесс облучения проводился при использовании источника ионов с холодным полым катодом [6], обеспечивающего пучок положительных ионов кислорода с плотностью тока 0.4 мА/см<sup>2</sup>, содержанием O<sub>2</sub><sup>+</sup>/O<sup>+</sup> > 3 и скомпенсированным по объемному заряду. Образцы помещались на водоохлаждаемом держателе на расстоянии 200 мм от источника ионов в области с рабочим давлением  $8 \cdot 10^{-5}$  Тор и предельным вакуумом  $\sim 10^{-6}$  Тор. Доза облучения задавалась временем облучения. Температура поверхности пленок при облучении контролировалась индивидуальным датчиком и составляла не более 150 °С.

Состояние поверхности и состав пленок до и после облучений анализировалось методами растровой электронной микроскопии (РЭМ), обратного резерфордовского рассеяния (ОРР) и масс-спектроскопии вторичных ионов (ВИМС).

Спектры ОП измерялись на автоматизированной спектральной установке, собранной на базе монохроматора МДР-23. Погрешность воспроизводимости спектров составляла не более 0.5%. Точность повышалась при измерении с использованием лазера. В этом случае луч лазера расщеплялся при помощи полупрозрачной пластины и регистрировался двумя фотодиодами, собранными по балансовой схеме. После разделения на пути одного из лучей устанавливался образец. Сигнал с выхода преобразователей ток-напряжение подавался на вольтметр В7-46, работающий в режиме измерителя отношения сигналов. Измерение спектров МКД производилось методом модуляции поляризованного света, описанного в работе [7].

## Экспериментальные результаты и их обсуждение

Для ряда пленок ЖИГ были проведены измерения коэффициента ОП  $k$  в интервале длин волн 500 ... 1100 нм. При измерении использовались образцы, на поверхности которых отсутствовали механические повреждения, микронеровности рельефа поверхности составляли менее 100 нм и для которых был проведен анализ однородности состава по толщине. Тем не менее исходные образцы отличались друг от друга значениями  $k$  на определенной длине волны, причем для более толстых пленок наблюдалось увеличение  $k$ . Поэтому в дальнейшем исследования проводились только на образцах, которые по характеру спектров

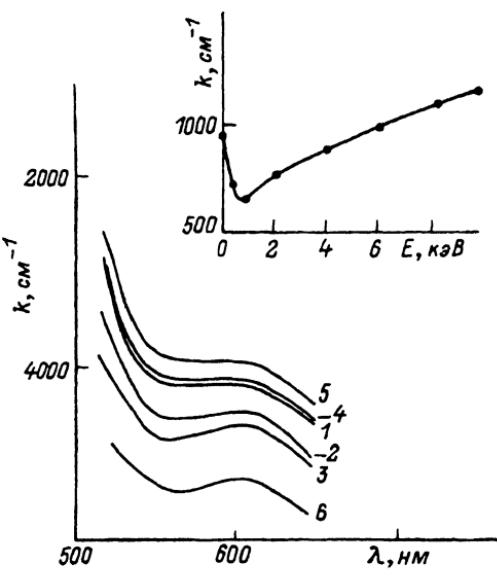


Рис. 1.

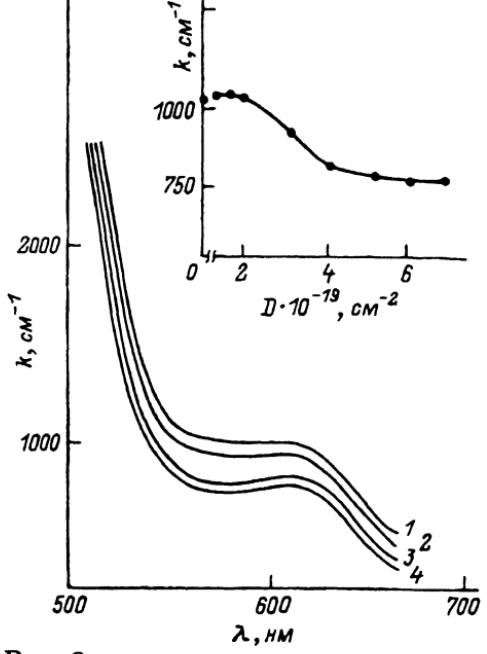


Рис. 2.

ОП и величине  $k$  были близки спектрам пленок ЖИГ, приведенных в [8], характеризующиеся минимальными отклонениями от спектров ОП монокристалла ЖИГ.

После облучений ионами с энергией в диапазоне  $E = 0.5 \dots 10 \text{ кэВ}$  и дозами  $D = 10^{18} \dots 10^{20} \text{ см}^{-2}$  было установлено, что наиболее существенные изменения в спектральных зависимостях ОП наблюдаются в области длин волн  $500 \dots 650 \text{ нм}$ . Причем облучение ионами с энергией  $E = 0.5 \dots 4 \text{ кэВ}$  приводит к уменьшению величины  $k$  по мере набора дозы более  $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$  и до значений  $D \sim 2 \cdot 10^{19} \dots 4 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$ . Дальнейшее увеличение дозы облучения оставляло уровень поглощения неизменным. Максимальное уменьшение величины  $k$  достигало 15% и наблюдалось при облучении пленок ионами кислорода с энергиями  $E = 1 \dots 2 \text{ кэВ}$ , причем слабо зависело от толщины исходных образцов. По мере увеличения энергии ионов выше 4 кэВ при дозах менее  $10^{19} \text{ см}^{-2}$  могли наблюдаться лишь незначительные уменьшения в ОП, а по достижении  $D > 10^{19} \text{ см}^{-2}$  происходило увеличение  $k$ , но не более чем на 1...3%. Результаты исследований приведены на рис. 1, 2. На рис. 1 показаны спектры ОП в пленке исходной толщины 7.8 мкм до (кривая 1) и после облучений дозой  $3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$  ионами кислорода с энергиями 1 (кривая 2), 2 (кривая 3), 6 (кривая 4) и 10 кэВ (кривая 5). Кривая 6, соответствующая монокристаллу ЖИГ, приведена для сравнения и взята из [1]. Кривая на вставке рис. 1 характеризует зависимость  $k$  на длине волны 555.5 нм от энергии ионов при постоянной дозе облучения  $3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$  указанного образца.

На рис. 2 приведена зависимость ОП в пленке толщиной 11.6 мкм от длины волны при различных дозах облучения ионами кислорода с энергией 1 кэВ. Кривая 1 соответствует исходному образцу, кривые 2-4 — облученному с  $D = 0.5 \cdot 10^{19}, 1.5 \cdot 10^{19}, \geq 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$  соот-

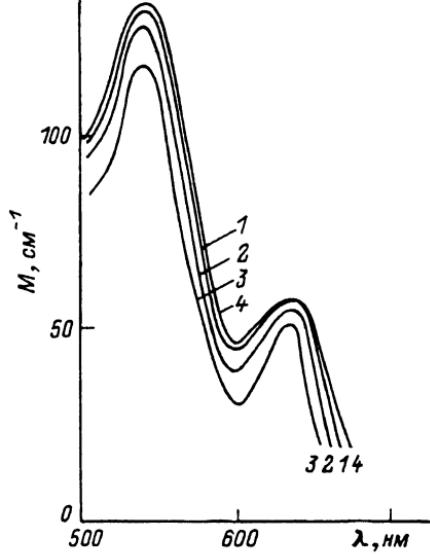


Рис. 3.

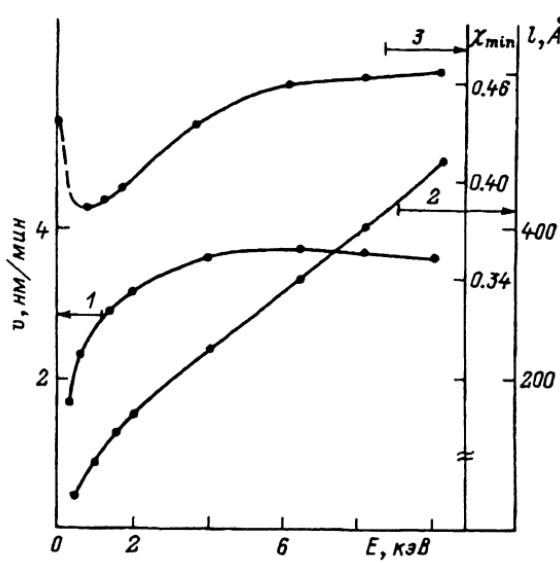


Рис. 4.

ветственно. На вставке рис. 2 показана кривая, характеризующая зависимость  $k$  от дозы облучения на длине волны 555.5 нм этого образца.

Анализ спектров МКД после облучений показал, что изменения МКД и ОП имеют идентичный характер. Абсолютное уменьшение величины МКД после облучений не превышало 8%, а ее увеличение с ростом энергии ионов было незначительным. На рис. 3 приведены спектральные зависимости МКД ( $M$ ) в пленке толщиной 11.6 мкм до (кривая 1) и после получений ( $D$ , кэВ: 2 —  $2 \cdot 10^{19}$ , 3 —  $4 \cdot 10^{19}$ , 4 —  $2 \cdot 10^{19}$ ;  $E$ , кэВ: 2, 3 — 1, 4 — 6).

Для объяснения полученных экспериментальных результатов был проведен анализ состояния образцов до и после облучений. Анализ показал, что в исходном состоянии пленки характеризуются довольно совершенной кристаллической структурой. Химический состав пленок толщиной от 6 до 12 мкм может быть описан формулой  $Y_{3-x}Pb_xFe_5O_{12}$  (где  $x \leq 0.1$ ), за исключением поверхностного слоя толщиной от 0.12 до 0.15 мкм. В этом слое средняя концентрация технологических примесей свинца больше, чем в объеме в 3–5 раз. В составе пленок фиксируется также наличие примесей платины, концентрация которой в общем в несколько раз меньше, чем примесей свинца, однако в поверхностном слое содержание платины возрастает почти на порядок по сравнению с объемным и становится сравнимым с количеством свинца в этом слое. Наблюдаются некоторые изменения в распределении по толщине и основных элементов, но кристаллическая структура сохраняется вплоть до поверхности, где находится структурно нарушенный слой толщиной менее 0.01 мкм.

Процесс облучения сопровождался распылением поверхности, образованием структурно нарушенного облученным слоя толщиной  $l$ , содержащего внедрившиеся ионы кислорода, и повышением степени совершенства кристаллической структуры пленки в объеме, характеризуемом уменьшением параметра  $\chi_{\min}$ . Параметр  $\chi_{\min}$ , величина которого пропорциональна количеству деканализированных на дефектах кристаллической структуры ионов  $H^+$ , определялся по общепринятой

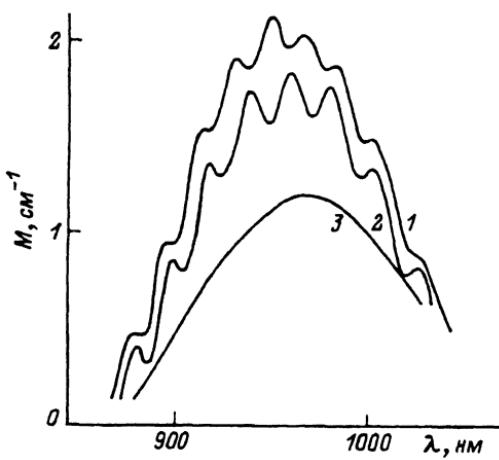


Рис. 5.

методике [9] на глубине 1.2 мкм от поверхности по спектрам ОПР. Скорость распыления  $v$  определялась по изменению толщины пленок после облучений на РЭМ фото при увеличении 20 000 крат. Толщина  $l$  находилась из спектров ОПР ионов  $H^+$  с энергией 2.3 МэВ согласно выражению  $l = n/N$ , где  $n$  — поверхностная плотность смещенных из узлов кристаллической решетки атомов,  $N$  — их объемная концентрация. Механизм воздействия низкотемпературного облучения на кристаллическую структуру объема пленки до конца не ясен.

На рис. 4 показана зависимость скорости распыления  $v$  от энергии ионов кислорода  $E$  (кривая 1). Измерения показали, что после 10–20 мин с начала облучения при определенной энергии скорость  $v$  с точностью до 0.1 имела постоянной значение, т. е. зависела от дозы  $D$ . Кривая 2 на рис. 4 характеризует зависимость толщины нарушенного облучением слоя  $l$  от энергии ионов при дозе облучения  $D = 2 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$ , а кривая 3 — соответственно параметра  $\chi_{\min}$ .

На основании приведенных зависимостей уменьшение ОП и МКД при воздействии низкоэнергетических ионов кислорода может быть объяснено распылением исходного поверхностного слоя ростового происхождения, обогащенного техническими примесями свинца и платины, и улучшением исходной кристаллической структуры в объеме при облучении дозами  $D > 10^{19} \text{ см}^{-2}$  ионов с энергией от 0.5 до 2 кэВ. При энергии ионов  $E \geq 5 \text{ кэВ}$  улучшения кристаллической структуры не наблюдалось, а толщина облученного слоя достигала десятков нанометров. Известно, что ОП в облученном слое может значительно скомпенсировано процессом распыления этого структурно нарушенного слоя. Более слабая в отличие от ОП зависимость МКД от параметров облучения в области длин волн 500...600 нм скорее всего связана с его природой, обусловленной разностью в поглощении лево- и правополяризованного света, и, следовательно, с меньшей чувствительностью к нарушениям на поверхности и вблизи ее, если исходить из независимости процессов рассеяния света на дефектах структуры, вызванных большедозовым облучением, от его поляризации.

Подтверждением последнего являются спектры МКД (рис. 5), снятые в интервале длин волн 850...1100 нм для пленки ЖИГ толщиной 11.6 мкм до (кривая 1) и после облучения ионами кислорода до

зой  $2 \cdot 10^{19}$  см $^{-2}$  с энергией 2 кэВ (кривая 2). Кривая 3 была получена для сравнения на монокристалле ЖИГ. Согласно рис. 5 уменьшение величины МКД после облучения достигает 30%, а сам спектр смещается к спектру монокристалла. Поэтому, сравнивая рис. 3 и 5, можно сделать вывод, что изменения в спектре МКД определяются скорее различиями в изменении локальных напряжений в тетра- и октаподрешетках железа, вызванных объемным воздействием облучения [9], чем процессами распыления и формирования облученного слоя, так как формирование спектров поглощения в более длинноволновой области (850...1100 нм) происходит в результате переходов в октаэдрических комплексах, а в коротковолновой (500...700 нм) — в тетраэдрических комплексах [2].

Этот вывод согласуется с полученными ранее результатами по объемному воздействию низкотемпературного облучения ионами кислорода на кристаллическую структуру пленок ЖИГ [10], где было показано методами мессбауэровской спектроскопии, что облученные образцы имели более совершенную магнитокристаллическую структуру, чем исходные. При этом, согласно мессбауэровским спектрам облученных пленок, величина квадрупольного расщепления для атомов железа, находящихся в октапозициях, уменьшалась на большую величину, чем находящихся в тетрапозициях для пленок, в которых в исходном состоянии примесное содержание свинца не превышало 0.1 формульной единицы. Последнее свидетельствует о более существенном уменьшении локальных напряжений, связанных с ионами железа, находящимися в октаэдрической подрешетке железа, в результате облучений.

Таким образом, облучение пленок ЖИГ ионами кислорода в режимах  $D > 10^{19}$  см $^{-2}$  и  $E = 0.5 \dots 2$  кэВ может служить средством улучшения оптических и магнитооптических свойств, так как позволяет уменьшить количество примесей свинца технологического происхождения вблизи поверхности путем распыления поверхностного слоя ростового происхождения и способствует улучшению исходной кристаллической структуры в объеме образцов.

### Список литературы

- [1] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. Прикладная магниооптика. М.: Энергогатом, 1990. 320 с.
- [2] Звездин А.К., Котов В.А. Магнитооптика тонких пленок. М.: Наука, 1988. 240 с.
- [3] Гесь А.П., Демченко А.И., Стогний А.И. и др. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. Вып. 1. С. 47-51.
- [4] Стогний А.И., Федотова В.В., Гесь А.П. и др. // ЖТФ. 1991. Т. 63. Вып. 2. С. 175-181.
- [5] Очилов О., Писарев Р.В. ФТТ. 1980. Т. 22. С. 2504-2506.
- [6] Стогний А.И., Токарев В.В. ПТЭ. 1990. № 3. С. 142-144.
- [7] Valiev U.V., Klochkov A.A., Sizoky P. Czechoslovak J. Phys. Vol. B38. N 6. P 697-698.
- [8] Агеев А.Н., Малых Н.В., Руткин О.Г., Шер Е.С. ЖТФ. 1983. Т. 53. Вып. 11. С. 2249-2252.
- [9] Feldman L.C., Mayer J.W.. Fundamentals of Surface and Thin Films Analysis. North-Holland, 1986. 342 р.
- [10] Стогний А.И., Федотова В.В., Гесь А.П. Всесоюзная школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники". Тез. докл. Ч. 2. Астрахань, 1992. С. 47-48.